



RBSビームライン



タンデム型高エネルギーイオン注入装置



バンデグラフ型イオン加速器

第41回 法政大学

イオンビーム工学研究所シンポジウム

THE 41st SYMPOSIUM ON MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
RESEARCH CENTER OF ION BEAM TECHNOLOGY, HOSEI UNIVERSITY

日時 2022年12月14日(水)

会場 法政大学小金井キャンパス

招待講演：オンライン

一般講演(ポスター)：現地

(JR中央線東小金井駅下車徒歩12分)

詳細 <https://www.hosei.ac.jp/ionbeam/katsudo/>



● 招待講演

「ナノ・マイクロデバイス科学の確立を目指した、先端的な半導体エレクトロニクス実装技術及び、バイオマテリアルの研究」

水野 潤 国立成功大学(台湾)

「イオンビーム照射技術を活用した半導体デバイスの宇宙放射線影響研究」

新藤 浩之 宇宙航空研究開発機構(JAXA)

● 一般講演募集

- 生体微量元素分析技術 ● ナノテクノロジー材料の創製
- 次世代エレクトロニクス材料 ● 新材料のプラズマプロセス
- 分析技術

など、イオンビーム技術と関連材料技術について募集します。

予稿締切 2022年11月11日(金)

● 参加費

無料(予稿集は当日までにホームページに掲載します。Proceedings 冊子は講演者及び希望者に後日郵送します。)

● 主催・問い合わせ先

法政大学イオンビーム工学研究所
〒184-8584 東京都小金井市梶野町3-7-2
TEL 042-387-6094, FAX 042-387-6095
E-Mail ion-sympo@ml.hosei.ac.jp

● 協賛

日本物理学会、応用物理学会、日本アイソトープ協会



イオンビーム工学研究所